

FIB-SEM (XVision200DB) 装置一覧

2026年 4月1日

装置番号	装置名称	設置場所	装置分類
FIB-01	FIB-SEM (エスアイアイ・ナノテクノロジー XVision200DB)	つくばセンター 2-1A棟2階234室	微細加工・ デバイス試作
FIB-02	イオンコーター (日立ハイテク E-1030)	つくばセンター 2-1A棟2階234室	微細加工・ デバイス試作